

要約書

基板処理装置、及びその制御方法

基板処理装置が開示される。一実施形態において、基板処理装置は、所定の流量で排水可能な排水バルブを備える複数の研磨ユニットと、所定の流量で排水可能な排水バルブを備える複数の洗浄ユニットと、前記複数の研磨ユニット及び前記複数の洗浄ユニットそれぞれの前記排水バルブを開閉制御可能な制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記複数の研磨ユニットと前記複数の洗浄ユニットからの総排水流量が所定の流量以内となるように、前記複数の研磨ユニットと前記複数の洗浄ユニットに割り振られた所定の優先順位に基づいて、前記複数の研磨ユニットと前記複数の洗浄ユニットの前記排水バルブを開閉制御する。

Figure 1